
 頭字語及び略語

これらのリストで使用される頭字語及び略語

頭字語又は略語は、定義された用語として使用される場合、'これらのリストで使用される用語'の中に見出される。

<u>頭字語又は略語</u>	<u>意味</u>
ADC	アナログデジタル変換
AGMA	American Gear Manufacturers' Association[米国歯車製造業者協会]
AHRS	attitude and heading reference systems [姿勢及び機首方位基準システム]
ALU	arithmetic logic unit[算術論理演算装置]
AISI	米国鉄鋼協会
ALE	原子層エピタキシー [膜が形成される反応プロセスをステップごとに分離、制御してその反応を1分子（原子）層ごとに完結させ、それを繰り返すことによって成膜する方法]
AMPS	Aircraft Missile Protection System [航空機ミサイル防御装置]
ANSI	American National Standards Institute[米国規格協会]
APP	Adjusted Peak Performance[加重最高性能]
APU	Auxiliary Power Unit[補助電源装置]
ASTM	American Society for Testing and Materials[米国材料試験協会]
ATC	air traffic control[航空交通管制]
BJT	Bipolar Junction Transistors[バイポーラ接続トランジスタ]
BPP	Beam Parameter Product[ビームパラメータ積] [ビーム径とビーム発散角の積]
BSC	Base Station Controller[基地局制御装置]
C ³ I	command, communications, control & intelligence [指揮、通信、統制及び情報]
CAD	computer-aided-design[コンピュータ支援設計]
CAS	Chemical Abstracts Service [ケミカルアブストラクトサービス]
CCD	Charge Coupled Device[電荷結合素子]
CDU	control and display unit[制御表示部]
CEP	circular error probable[平均誤差半径]
CMM	Coordinate Measuring Machine[三次元測定機]
CMOS	Complementary Metal Oxide Semiconductor [相補型金属酸化膜半導体]

 頭字語及び略語

これらのリストで使用される頭字語及び略語
頭字語又は略語意味

CNTD	controlled nucleation thermal deposition[制御核反応利用・熱分解]
GPLD	Complex Programmable Logic Device[結合プログラマブルロジックデバイス]
GPU	central processing unit[中央処理装置]
CVD	chemical vapour deposition[化学気相成長法]
CW	chemical warfare[化学戦]
CW	(for lasers)continuous wave[持続波]
DAC	Digital-to-Analogue Converter[デジタルアナログ変換]
DANL	Displayed Average Noise Level[表示平均雑音レベル]
DBRN	Data-Base Referenced Navigation[データベース参照航法]
DDS	Direct Digital Synthesizer[デジタル直接合成発振器]
DEW	directed energy weapon systems[指向性エネルギー兵器システム]
DMA	Dynamic Mechanical Analysis[動的機械分析]
DME	distance measuring equipment[距離測定装置]
DMOSFET	Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor [二重拡散 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ]
DS	directionally solidified[一方向性凝固]
EB	Exploding Bridge[起爆電橋]
EB-PVD	electron beam physical vapour deposition [電子ビーム物理蒸着法]
EBW	Exploding bridge wire[起爆電橋線]
ECAD	Electronic Computer-Aided Design[電気設計専用 CAD]
ECM	electro-chemical machining[電解加工]
EDM	electrical discharge machines[放電加工機]
EFI	Exploding Foil Initiators[爆発箔起爆剤]
EIRP	Effective Isotropic Radiated Power[等価等方輻射電力]
EMCDB	elastomer modified cast double based propellants [エラストマー改善型ダブルベース推進薬]
EMP	Electromagnetic Pulse[電磁パルス]
ENOB	Effective Number of Bits[有効ビット数]
ERF	Electrorheological Finishing[電気粘性流体研磨法]
ERP	Effective Radiated Power[実効輻射電力]
ESD	Electrostatic Discharge[静電放電]

 頭字語及び略語

これらのリストで使用される頭字語及び略語

<u>頭字語又は略語</u>	<u>意味</u>
ETO	Emitter Turn-Off Thyristor [エミッタターンオフサイリスター]
ETT	Electrical Triggering Thyristor [エレクトリカルトリガリングサイリスター]
EUV	Extreme Ultraviolet [極端紫外]
FADEC	Full Authority Digital Engine Control [フルオーソリティデジタルエンジン制御]
FFT	Fast Fourier Transform [高速フーリエ変換]
FPGA	Field Programmable Gate Array [フィールドプログラマブルゲートアレイ]
FPIC	Field Programmable Interconnect [フィールドプログラマブル相互接続用集積回路]
FPLA	Field Programmable Logic Array [フィールドプログラマブルロジックアレイ]
FPO	Floating Point Operation [浮動少数点演算]
FWHM	Full-Width Half-Maximum [半値全幅]
GAAFET	Gate-All-Around Field-Effect Transistor [ゲートオールラウンド FET]
GSM	Global System for Mobile Communications [グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション]
GTO	Gate Turn-off Thyristor [ゲートターンオフサイリスター]
GVWR	Gross Vehicle Weight Rating [車両総重量評価]
HBT	hetero-bipolar transistors [ヘテロバイポーラトランジスタ]
HDDR	high density digital recording [高密度デジタル記録装置]
HDMI	High-Definition Multimedia Interface [高精細マルチメディアインタフェース]
HEMT	high electron mobility transistor [高電子移動トランジスタ]
ICAO	International Civil Aviation Organisation [国際民間航空機関]
IEC	International Electro-technical Commission [国際電気標準会議]
IEEE	Institute of Electrical and Electronic Engineers [米国電気電子技術者協会]
IFOV	instantaneous-field-of-view [瞬時視野]
IGBT	Insulated Gate Bipolar Transistor [絶縁ゲートバイポーラトランジスタ]

 頭字語及び略語

これらのリストで使用される頭字語及び略語

頭字語又は略語
意味

IGCT	Integrated Gate Commutated Thyristor [集積ゲート整流サイリスタ]
IHO	International Hydrographic Organization [国際水路機関]
ILS	instrument landing system [計器着陸装置]
IMU	Inertial Measurement Unit [慣性測定ユニット]
INS	Inertial Navigation System [慣性航法装置]
IP	Internet Protocol [インターネットプロトコル]
IRS	Inertial Reference System [慣性参照システム]
IRU	Inertial Reference Unit [慣性参照ユニット]
ISA	international standard atmosphere [国際標準大気]
ISAR	inverse synthetic aperture radar [逆合成開口レーダー]
ISO	International Organization for Standardization [国際標準化機構]
ITU	International Telecommunication Union [国際電気通信連盟]
JT	Joule-Thomson [ジュール・トムソン]
LIDAR	light detection and ranging [光探知及び測距装置“ライダー”]
LIDT	Laser Induced Damage Threshold [レーザー損傷閾値]
LOA	Length Overall [全長]
LRU	line replaceable unit [ライン交換ユニット; 部隊整備で交換可能な構成品等]
LTT	Light Triggering Thyristor [光トリガリングサイリスタ]
MLS	microwave landing systems [マイクロ波着陸装置]
MMIC	Monolithic Microwave Integrated Circuit [モノリシックマイクロ波集積回路]
MOCVD	metal organic chemical vapour deposition [有機金属気相成長法]
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor [金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ]
MPM	Microwave Power Module [マイクロ波用電力モジュール]
MRF	Magnetorheological Finishing [磁性流体研磨法]
MRF	Minimum Resolvable Feature size [最小解像度]
MRI	magnetic resonance imaging [磁気共鳴イメージング]
MTBF	mean-time-between-failures [平均故障間隔]
MTTF	mean-time-to-failure [平均故障時間]
NA	Numerical Aperture [開口数]

 頭字語及び略語

これらのリストで使用される頭字語及び略語

頭字語又は略語

意味

NDT	non-destructive test[非破壊検査]
NEQ	Net Explosive Quantity[正味火薬量]
NIJ	National Institute of Justice[国立司法研究所]
OAM	Operations, Administration or Maintenance[操作、管理若しくは保守]
OSI	Open Systems Interconnection[開放型システム間相互接続]
PAI	Polyamide-imides[ポリアミドイミド]
PAR	precision approach radar[精測進入レーダー]
PCL	Passive Coherent Location [電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置]
PDK	Process Design Kit[プロセスデザインキット]
PIN	personal identification number[個人 ID(識別)番号]
PMR	Private Mobile Radio[プライベートモバイル無線]
PVD	Physical Vapour Deposition[物理蒸着法]
QAM	quadrature-amplitude-modulation[直交振幅変調]
QE	Quantum Efficiency[量子効率]
RAP	Reactive Atom Plasmas[反応性原子プラズマ]
RF	radio frequency[無線周波数]
RNC	Radio Network Controller[無線ネットワーク制御局]
ROIC	Read-out Integrated Circuit[読み出し集積回路]
RPV	remotely piloted air vehicles[遠隔操縦ヴィークル、無人航空機]
S-FIL	Step and Flash Imprint Lithography [ステップアンドフラッシュ・インプリントリソグラフィ]
SAR	synthetic aperture radar[合成開口レーダー]
SAS	Synthetic Aperture Sonar[合成開口ソナー]
SC	single crystal[単結晶]
SCR	Silicon Controlled Rectifier[シリコン制御整流素子]
SFDR	Spurious Free Dynamic Range[スプリアスフリー・ダイナミックレンジ]
SHPL	Super High Powered Laser[超高出力レーザー発振器]
SLAR	sidelooking airborne radar[側方監視機上レーダ]
SOI	Silicon-on-Insulator[シリコン・オン・インシュレータ]
SQUID	Superconducting Quantum Interference Device[超伝導量子干渉素子]

 頭字語及び略語

これらのリストで使用される頭字語及び略語
頭字語又は略語意味

SRA	shop replaceable assembly[ショップ交換可能アセンブリ]
SRAM	static random access memory[スタティック RAM]
SSB	single sideband[単側波帯]
SSR	secondary surveillance radar[二次監視レーダ]
SSS	Side Scan Sonar[サイドスキャンソナー]
TE-PVD	Thermal Evaporation-Physical Vapour Deposition [加熱蒸発による物理蒸着法]
TIR	total indicated reading[インジケータ実指示]
TVR	Transmitting Voltage Response[送波電圧感度]
UPR	Unidirectional Positioning Repeatability[一方向位置決め繰返し性]
UTS	ultimate tensile strength[最大引張強度]
VJFET	Vertical Junction Field Effect Transistor [垂直接合型電界効果トランジスタ]
VOR	very high frequency omni-directional range[超短波全方位式無線標
識]	
WLAN	Wireless Local Area Network[無線 LAN]